

**17-19 жовтня 2018 року**

Україна, Київ

**МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ**

**IX Науково-практична конференція НАН України**  
**«Новітні розробки наукового обладнання провідних приладобудівних компаній.**  
**Розвиток центрів колективного користування в НАН України»**

<b>Дата та час проведення:</b>	18 жовтня 2018, 10.00-17.00
<b>Місце проведення:</b>	м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон №1, зал №9
<b>Організатор:</b>	Національна академія наук України
<b>Організаційний комітет:</b>	<i>Сторіжко В.Ю., ак. НАН України, голова конференції, голова Міжвідомчої ради з наукового приладобудування при Президії НАН України; Кубальський О.Н., к.філос.н., заст. голови, перший заступник головного вченого секретаря НАН України; Майстренко В.Л., к.ф.-м.н., заступник начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України; Котенко В.А., к.ф.-м.н., заступник начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України; Жирко Ю.І., к.ф.-м.н., секретар Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України; Колтун О.Я., к.т.н., директор Експозиційного центру «Наука» НАН України; Костецький В.І., к.т.н., секретар конференції</i>

**ПРОГРАМА\***

<b>11.00 –11.05</b>	<b>Вступна промова на відкритті науково-практичної конференції</b> <i>Сторіжко В.Ю., голова конференції академік НАН України</i>
<b>11.05 –11.30</b>	<b>Розробка системи вимірювання трибологічних характеристик надтонких плівок</b> <i>Марченко О.А., чл.-кор. НАН України, зав. відділу Інституту фізики НАН України</i>
<b>11.30 –11.50</b>	<b>Устаткування протонно-променевої літографії на базі електростатичного прискорювача для фабрикації 3D мікро- і нано-структур</b> <i>Пономарьов О.Г., д.ф.-м.н., проф., зав. відділу Інституту прикладної фізики НАН України</i>
<b>11.50 –12.10</b>	<b>Термоелектричні охолоджувачі для рентгенівських детекторів</b> <i>Прибила А.В., к.ф.-м.н., с.н.с., Інституту термоелектрики НАН та МОН України</i>
<b>12.10 –12.40</b>	<b>ПЕРЕРВА</b>
<b>12.40 –13.00</b>	<b>Сучасне науково-аналітичне обладнання для науки та промисловості від японської компанії Tokyo Voeki Technology Ltd</b> <i>Тиньков В.О., представник компанії Tokyo Voeki</i>
<b>13.00 –13.10</b>	<b>Сучасні інструментальні методи елементного аналізу</b> <i>Василенко А.П., к.х.н., спеціаліст відділу аналітичного обладнання компанії АЛТ Україна Лтд</i>
<b>13.10 –13.20</b>	<b>Унікальні рішення для мікроскопії надвисокої роздільної здатності від Leica Microsystems</b> <i>Козак Д.П., спеціаліст відділу мікроскопії компанії АЛТ Україна Лтд</i>
<b>13.20 –13.40</b>	<b>Обладнання для елементного, молекулярного термоаналізу та обладнання для аналізу поверхні, що пропонує компанія INTERTECH Corporation</b> <i>Артем'єва І.М., директор представництва компанії INTERTECH Corporation в Україні</i>
<b>13.40 –14.00</b>	<b>Сучасні методи та засоби дослідження фізико-хімічних властивостей матеріалів</b> <i>Верцанова О.В., к.т.н., генеральний директор компанії Мелітек-Україна</i>
<b>14.00 –14.20</b>	<b>Новітні розробки аналітичного обладнання корпорації SHIMADZU</b> <i>Сухомлинов О.Б., директор компанії ШімЮкрейн</i>
<b>14.20 –14.40</b>	<b>3D оптична мікроскопія Bruker</b> <i>Онопрієнко Є.В., керівник відділу матеріалознавства компанії OPTEC LLC</i>
<b>14.40 –15.00</b>	<b>Спектральне обладнання компанії СОЛАР Лазерні Системи для наукових досліджень та прикладних завдань</b> <i>Наталія Дідковська, ЗАТ Солар ЛС</i>
<b>15.00 –16.30</b>	<b>Круглий стіл – Щодо розвитку центрів колективного користування в НАН України за участю вчених України, представників фірм-виробників, Організаційного комітету конференції</b>